BAM
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

Referenzverfahren

Weißlichtinterferenzmikroskopie (WLIM) zur Bestimmung von Topographiekennwerten an reflektierenden Oberflächen

Kompetenznachweis

ISO/IEC 17025 Akkreditierung

Prüfgrößen und -objekte

Vertikale und laterale Topographiekennwerte wie Rauheit, Welligkeit und Form
Maximale Objektgröße (150 × 150 × 100) mm^3

Prüfbereich

Vertikaler Messbereich:	6 nm bis	145 µm
Lateraler Messbereich:	3 µm bis	3 mm

Erweiterte Messunsicherheit (k = 2)

Messbereich vertikal:

20 nm bis	7 µm,	U < 0,5 %
7 µm bis	50 µm,	U < 0,7 %
50 µm bis	145 µm,	U < 1 %

Anwendungsbereich

Oberflächenmesstechnik: Topometrie technischer Oberflächen, Stufenhöhen- und Schichtdickenmessung

Referenzen

VDI/VDE 2655 - Blatt 1.1:2008-03, Optische Messtechnik an Mikrotopographien - Kalibrieren von Interferenzmikroskopen und Tiefeneinstellnormalen für die Rauheitsmessung, https://www.vdi.de/2655-1.1.
VDI/VDE 2655 Blatt 1.3:2020-02, Optische Messtechnik an Mikrotopografien - Kalibrieren von flächenhaft messenden Interferometern und Interferenzmikroskopen für die Formmessung, https://www.vdi.de/2655-1.3.

Ansprechperson

Matthias Weise
Matthias.Weise@bam.de
030 8104-3516